株式会社イオンテクノセンター

3_酸化ガリウムへのイオン注入

青木正彦

今回は次世代パワー半導体デバイスとして期待されているベータ型酸化ガリウムへのイオン注入現 象について説明します⁽¹⁾。

結晶構造

MARLOWE コードでは単結晶構造を扱うことができます。しかしながらターゲットの構造を正確に 設定しなければなりません。結晶の単位格子における原子の配置、結合エネルギー、結晶の振動状態を 表すデバイ温度などを与えなければなりません。単位格子における原子の配置に関しては結晶の対称性 を理解していなければ正しいデータを与えることができません。ここでは最初に結晶構造を指定するた めに必要な情報を紹介します。MARLOWE では以下のような結晶系を扱うことができます。

- 1. 単純(Primitive)
- 2. 体心(Body-centered)
- 3. A センタリング(End-centered A)
- 4. B センタリング(End-centered B)
- 5. C センタリング (End-centered C)
- 6. 面心 (Face-centered)

前回取り上げた窒化ガリウムはhP4 と表現されます。これは六方晶(hexagonal)の構造の単純格子 (Primitive)であり原子が4個含まれることになります。結晶軸座標の値は以下の通りです。

	Х	У	Z
Ga	0.0	0.0	0.0
Ga	0.3333	-0.3334	0.5
N	0.0	0.0	0.3772
N	0.3333	-03334	-0.1228

さてベータ型酸化ガリウムの結晶構造はピアソン記号では mC20 となります。この表記は'm'が単斜 晶(monoclinic)を表し、'C'は C センタリングを表しています。そして'20'は単位格子内に原子が 20 個 含まれていることを示しています。C センタリングとは基本となる結晶を C 面の中心位置に平行移動さ せて本来の結晶構造を作る操作を意味します。具体的には平行移動のベクトルは(0.5, 0.5, 0)となりま す。具体的な結晶軸座標を以下の表にまとめました。この構造に対する対称性の操作により最終的に 20 個の格子が作られます。

> Copyright © 2021 Ion Technology Center Co., Ltd. All Rights Reserved. 転載、複製、改変等は禁止します。

	Х	Y	Z
Ga1	0.0904	0	0.2948
01	0.1674	0	0.6011
02	0.1721	0	0.0635
Ga2	0.3414	0	0.1857
03	0.5043	0	0.2447
Ga1	0.9096	0	0.7052
01	0.8326	0	0.3989
02	0.8279	0	0.9365
Ga2	0.6586	0	0.8143
03	0.4957	0	0.7553

ベータ型酸化ガリウムの場合、格子定数は a 軸=12.2247 Å, b 軸=3.0403 Å および c 軸=5.8088 Å です。結晶軸のなす角度は α =90 度, β =103.82 度および γ =90 度となります。酸化ガリウムの単位 格子の体積は下記の式で表されます。

$$V = \frac{1}{2}abc\,\sin\beta$$

この式から体積は 209.356Å³となります。この値から原子密度は 9.55E22 n/cm3 と求められます。 下記に各結晶面から見た場合の結晶構造を示します。この結晶モデルは VESTA⁽²⁾および ReciPro⁽³⁾ というソフトウェファによって作成されました。



A-axis

B-axis

ベータ型酸化ガリウムへのイオン注入

前回の記事で説明したようにイオン注入現象は核による阻止能と電子による阻止能によって説明で きます。Mgを酸化ガリウムに注入した場合の阻止能をシミュレーションコード SRIM⁽⁴⁾によって求めた 結果を次のグラフに示します。核阻止能と電子阻止能が一致するエネルギーは 180keV 付近となります。 このエネルギー以下では核による阻止能が支配的で、このエネルギー以上では電子による阻止能が支配 的になります。



結晶構造から考えると b 軸に沿ってイオンを注入するとイオンが基板深くまですり抜けるチャンネ リング現象が生じやすいことがわかります。下記のグラフはベータ型酸化ガリウムにイオン注入した場 合のプロファイルを示しています。プロファイルからわかるように b 軸に沿ってイオン注入を行うとチ ャンネリングが生じて 2µm 程度の深さまで侵入します。しかしチルト角度をつけることによってラン ダム注入条件が実現し、チャンネリングを抑制できることが分かります。



Copyright © 2021 Ion Technology Center Co., Ltd. All Rights Reserved. 転載、複製、改変等は禁止します。

株式会社イオンテクノセンター

イオン注入によるダメージ

イオン注入によるダメージは衝突によって生じるフレンケル対の数によって評価できます。次の図には チルト角度を変えた場合にフレンケル対の数がどのように変わるかを調べた結果を示します。エネルギ ーが低い場合はチルト角度を変えてもフレンケル対の数は大きく増加していません。しかしエネルギー が高くなるとチルト角度によってフレンケル対の数が増加し、5度以上のチルト角度でフレンケル対の数 が安定することが分かります。



以上のように窒化ガリウムへのイオン注入現象を MARLOWE コードによる解析結果を用いて説明 しました。他のターゲットに関しても結晶構造を正確に指定することによってイオン注入現象を解析す ることができます。

参考文献

- 1) Z. Hou, et. al., Electrons devices Lett.39, 6, 869 (2018)
- K. Momma and F. Izumi, "VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data," J. Appl. Crystallogr., 44, 1272–1276 (2011)
- 3) http://pmsl.planet.sci.kobe-u.ac.jp/~seto/?page_id=19&lang=ja
- 4) http://www.srim.org/

お問い合わせ先: 株式会社イオンテクノセンター

URL: https://iontc.co.jp/contact/

Copyright © 2021 Ion Technology Center Co., Ltd. All Rights Reserved. 転載、複製、改変等は禁止します。